

MEMS研究支援サービス

「マイクロナノ・オープンイノベーションセンター」

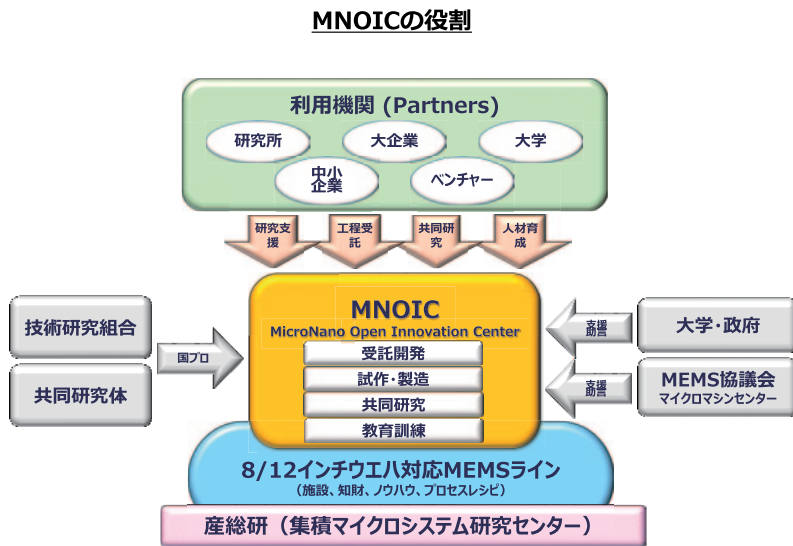
MEMS research & development support service "MicroNano Open Innovation Center (MNOIC)"

目的： MNOICは、マイクロナノ・MEMS領域での産業競争力強化のため、TIA-MEMS分野のオープンイノベーションを強力に推進します。

方法： 産総研集積マイクロシステム研究センター保有の最先端MEMS研究成果・設備を活用し、業界の幅広いニーズに応える研究開発支援や研究受託、工程受託などの多様なサービスを行います。

展望： 産業界への貢献を最大化するため、運営体制強化、設備拡充などを進めていきます。

MNOICの概要

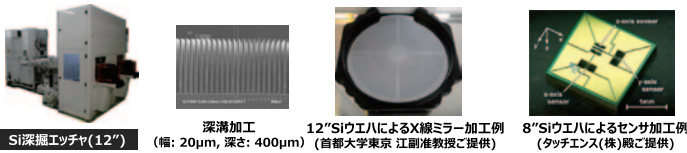


産総研MEMS研究開発施設の共用設備

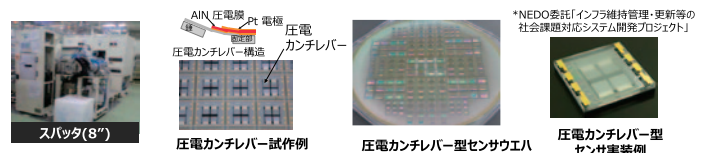


加工事例

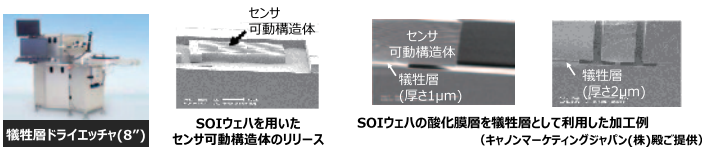
- 8/12インチSi深掘エッチャによる高アスペクト比加工
→ X線レンズ、MEMSセンサ開発への適用



- AIN圧電性薄膜スパッタ成膜
→ 圧電カンチレバー型センサ開発への適用（国プロ成果*）



- 犠牲層ドライエッチャによるMEMS構造体のリリース
→ センサ加工プロセス開発への適用



- ウエハtoウエハ、チップtoウエハ接合装置による常温での接合
→ センサ/TSV基板実装への適用

